24Aa01

高強度短パルスレーザーを用いた強磁場生成とその応用

Kilotesla magnetic field generation using high-intensity short-pulse lasers and its applications

Hiroki Morita, Yuki Abe¹, Law King Fai Farley¹, Baojun Zhu¹, Ryunosuke Takizawa¹, Dun Jinyuan¹, Takayoshi Sano¹, Masakatsu Murakami¹, Shinsuke Fujioka¹

Utsunomiya Univ., ¹ILE, Osaka Univ.

キロテスラ級の強磁場は高エネルギー密度 プラズマにおいて、流体的不安定性や高エネル ギー荷電粒子ビームの制御、レーザー核融合な どの応用研究や、磁気リコネクション、無衝突 衝撃波などの基礎研究など、様々な用途で用い られている。強磁場を生成する方法としてよく 用いられているのが、レーザー駆動コイルであ る。テラワット級のナノ秒高出力レーザーと組 み合わせることで数百テスラに及ぶ強磁場を 生成することができる。

2018年にはレーザー駆動コイルにパルス幅 がピコ秒以下の短パルス高強度レーザーを用 いると、磁場の発生時間は短くなる代わりに、 レーザーから磁場へのエネルギー変換効率は、 従来のナノ秒高出力レーザーを使う場合より も10~100倍ほど高いということが報告された [1]。しかし短パルスレーザー駆動の磁場生成に 関しては、実験的にも理論的にも十分に調べら れておらず、そのメカニズムは十分に理解され ていない。短パルスレーザー照射による高温電 子および電圧の発生メカニズムは、従来のナノ 秒高出力レーザー照射による場合と大きく異 なるため、従来の磁場発生モデルは適応出来ず、 改善や新たな開発が必要である。

一般的にレーザー駆動コイルは、二枚の金属 板がワイヤーコイルでつながれた形状をして いる。高強度短パルスレーザーを用いる場合、 レーザー照射時の電荷欠損が主な電圧生成の ソースとなる。先行研究では、電荷欠損に伴う 帯電および放電をベースに、短パルスレーザー 照射時の電流についてモデルが構築された[1]。 しかし、このモデルでは、非照射側の金属板の 影響やパルス幅の影響が十分に考慮されてい ない。非照射板の影響は、照射レーザーのパル ス幅が、レーザー生成電子がもう片方の板に到 達するまでの数ピコ秒の時間スケールよりも 長い場合に顕著に生じることが予想される。



そこで今回、我々は非照射板の影響および照 射レーザーのパルスの影響を考慮したモデル を開発した。図1は、レーザー駆動コイルに短パ ルスレーザー照射した際に生成される磁場の 時間発展について、実験結果、既存モデルおよ び開発したモデルを比較したものである。どち らのモデルについても実験結果をよく再現し ているが、Wang et alのモデルの場合、パルス幅 の効果(この実験では30 fs)を考慮すると、実験 結果を再現できない。また、Wang et alのモデル では、高エネルギー電子へのエネルギー変換効 率が40%と高く設定されているが、我々が開発 したモデルでは、25%で実験結果を再現できる。 この変換効率は過去の実験結果ともおよそ一 致している[2]。

また、最近では、図2に示すような非照射板を 持たない「スネル型マイクロコイル」に直接、 高強度レーザーを照射することでキロテスラ 級の強磁場を生成できるということが数値的 に、また実験的にも検証されている[3,4]。これ と合わせて、スネル型コイルで生成できる磁場 を種磁場として、1MTに及ぶ超強磁場生成が可 能であるということを示唆することも数値的



コイルの計算例.(a)一方向磁場[4].(b)半平行磁場[8].

に予測されている[5,6]。図2(a)に示すようにコ イルの端に高強度レーザーを照射すると、電荷 欠損に伴う帰還電流によりコイル中心に最大2 kTの磁場が生成される。コイル中心に生成され る磁場の時間発展も実験的に計測し、キロテス ラに及ぶ強磁場が100 ps程度維持できることが 示された。今回開発した磁場生成モデルは、ス ネル型コイルを用いて生成できる強磁場につ いても、よく一致する結果を与えた。

このスネル型コイルは、レーザーの集光位置 を変えることで、図2(b)に示すように、コイル断 面で半平行な磁場構造を作ることができる[7]。 高強度レーザーをスネル型コイルのもう一端 にも当たるように照射すると、電荷欠損がコイ ルの両端で生じ、両端から帰還電流が流れる。 帰還電流とコイル内面に生じる高速電子流に よりコイル断面には二つの回路が生じる。この とき発生する磁場は、図2(b)のような反平行構 造を形成する。このような半平行磁場がある状 況では、磁場の界面において、相対論的磁気リ コネクションとそれに伴う粒子加速が発生す る。我々はこのコンセプトに基づき、磁気リコ ネクションに関する実験を行い、スネル型コイ ルを用いて、1psの間に2.1kTの最大磁場を観測 し、冪乗のエネルギースペクトルを示す電子も 同時に観測した。

高強度レーザーを用いて生じる強磁場をイ オン加速に応用するという研究もいくつか行 われている[9,10]。レーザー駆動イオン加速の代 表例の一つとして、Target Normal Sheath Acceleration (TNSA)という機構がある。薄膜ターゲッ トに対して高強度レーザーを照射すると、加速 された電子はターゲット裏面を抜ける際に、電 荷分離に伴う強力な電場を生成する。TNSAで は、この電場によって、ターゲット裏面に付着 するイオンが高エネルギーまで加速される。こ のとき、電子が加速されることで薄膜では電荷 欠損が生じている。薄膜にソレノイド型コイル を取り付けておくことで、スネル型コイルの場 合と同じように、薄膜での電荷欠損による大電 流がコイルに流れ、強磁場を生成できる。この 強磁場はイオン加速と同時に生成されるため、 強磁場による自発的なイオンビームの収束効 果が期待できる。

最近、我々はこの原理実証実験を行い、強磁場による陽子ビームの収束に成功した。図3(a)、 (b)はそれぞれ、ソレノイドコイル付きの薄膜ターゲット、薄膜ターゲットのみを用いた場合の陽子ビームパターンである。青色で示している部分が、陽子線量が多い部分に対応している。図3(a)、(b)を見比べると明らかなように、ソレノイド型コイルを取り付けた場合、もう一方と比べて2倍以上ビーム径が小さい陽子ビームが観測された。この結果はコイルで陽子ビームを収束するのに十分な磁場が発生していたことを示している。陽子ビームはラジオクロミックフィルムで検出された。どちらの場合も300Jのエネルギーでレーザーを薄膜に照射した。

陽子ビームの計測と併せて、ソレノイド型コ イルによって生成される磁場の時間発展も同 時に計測し、数十ピコ秒の間、1kT以上の磁場 が持続していることを観測した。これについて も開発した磁場生成モデルとの比較を行い、モ デルが実験結果とよく一致することを示した。 本講演では、上記の結果の詳細について議論



【参考文献】

する。

- [1] W. Wang et al., Phys. Plasmas 25, 083111 (2018)
- [2] Y. Ping et al.k Phys. Rev. Lett. 100, 085004 (2008)
- [3] E. Ehret *et al.*, Phys. Rev. E 106, 045211 (2022)
- [4] Iu. V. Kochetkov et al., Sci. Rep.| (2022) 12:13734
- [5] M. Murakami et al., Sci. Rep. (2020) 10:16653
- [6] M.-A. H. Zosa et al., Appl. Phys. Lett. 120, 132403 (2022)
- [7] P. Korneev et al., Phys. Rev. E 91, 043107 (2015)
- [8] K. F. F. Law et al., Phys. Rev. E 102, 033202 (2020)
- [9] K. Weichman et al., Sci. Rep.| (2020)10:18966
- [10] K. Weichman et al., Phys. Plasmas 29, 053104 (2022)